DIN 50450-2:2026-03 (D)

Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Bestimmung von Verunreinigungen in Träger- und Dotiergasen - Teil 2: Bestimmung der Sauerstoffverunreinigung in Stickstoff, Argon, Helium, Neon und Wasserstoff mittels einer galvanischen Messzelle

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe 4

4 Einheiten 4

5 Kurzbeschreibung des Verfahrens 4

6 Prüfeinrichtung 4

7 Betriebs- und Kalibriergase, Chemikalien 5

8 Vorbereitung 5
8.1 Probenvorbereitung 5
8.2 Messvorbereitung 5
8.2.1 Einstellen des Nullpunktes 5
8.2.2 Einstellen des Kalibrierpunktes 5

9 Durchführung 5

10 Auswertung und Messunsicherheit 6

11 Prüfbericht 6

Anhang A (informativ) Beispiele zur Berechnung der Messunsicherheit 7
A.1 Berechnung der Messunsicherheit auf Basis einer Zweipunktkalibrierung 7

Literaturhinweise 9

Tabellen

Tabelle A.1 — Daten zur Berechnung des Messergebnisses 7

Tabelle A.2 — Messergebnis und Standardunsicherheiten 8